## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 9日現在

機関番号: 1 2 5 0 1
研究種目: 基盤研究(B)
研究期間: 2011~2013
課題番号: 2 3 3 6 0 0 6 7
研究課題名(和文)高精度複合型ダイヤモンドツールの開発と微細構造デバイスへの応用に関する研究
研究課題名(英文)Development of precision hybrid diamond tool and its application to micro-device fab rication
研究代表者
森田 昇(Morita, Noboru)
千葉大学・工学(系)研究科(研究院)・教授
研究者番号:30239660
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,200,000円、(間接経費) 4,260,000円

研究成果の概要(和文):本研究は、各種極微細加工用の高精度複合型ダイヤモンドツールの開発と微細構造デバイス への応用を目的としている。各種形状のシリコンモールド作製技術と、高緻密高速成膜可能なダイヤモンドCVD 技術を 駆使して、高精細のアレイ状ダイヤモンド薄膜から形状精度よく切れ刃(ダイヤモンドチップ)を抽出し、それを工具 シャンクに高強度で装着する手法を確立し、ダイヤモンドチップとシャンクとを高精度で位置決め可能なステージやセ ンサを具備した工具作製装置を構築した.各種の微細加工機能を具備するダイヤモンドツールを開発するとともに、高 アスペクト比の微細V 溝加工を実現するツールを開発した。

研究成果の概要(英文): The purpose of this study was to develop high precision micro-diamond tool and to apply device fabrication with micro-structure. A diamond cutting tool was fabricated with silicon mold, an d CVD diamond deposition, and then the edge with point, front, and side angles was conditioned with FIB. T he diamond tool was attached to tool holders. In order to attach in desired position accurately, tool fabrication machine was fabricated. High-aspect ratio V-groove machining was demonstrated with the developed t ools.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・生産工学・加工学

キーワード: 微細加工 AFM FIB カンチレバー

## 1.研究開始当初の背景

超精密加工技術の発展にともない、ナノス ケールオーダーの機械加工技術が求められ ている。これを達成するためには、工作機械 の高精度化とともに、切削工具の高精度化 が必須である。工作機械については運動精度 をナノスケールオーダーで実現する実用技 術が存在するが、切削工具の形状精度につい てはマイクロスケールオーダーが限界とさ れている。

申請者らは、シリコンモールド金型とダイ ヤモンド CVD 技術を併用し、切れ刃先端形 状と砥粒分布を精密に規定できる微細工具 (ダイヤモンドアレイ工具)の創成方法を提 案・検証するとともに、これをマイクロ・ナ ノスケールの超精密加工への適用の可能性 について研究を進めており、以下のような成 果をあげている。

創成したダイヤモンドアレイ工具の切れ 刃(ダイヤモンドチップ)一つを回転シャン ク端面に装着することにより、マイクロミリ ングツールを開発した。図1 は、試作したマ イクロミリングツールである。また図2 は、 高剛性のシリコンカンチレバー先端にダイ ヤモンドチップ装着して作製した加工用 AFM カンチレバーである。

このツールを用いて、アクリル板、金属ガ ラス、単結晶シリコンウェハなど種々の材料 に対してミリング加工実験を行ったところ、 ツールの破損もなく能率の高い微細加工が 可能で、マイクロスケールオーダーの極微細 加工に有用であるが、ダイヤモンドチップの シャンクへの装着に人為的な作業が含まれ るため生産性が劣るとともに、ナノスケール オーダーの微細加工への適用には難しいこ とがわかった。加工用 AFM カンチレバーに ついても、刃先角がシリコンモールドの形状 で決定されるため、アスペクト比の高いV 溝 加工は不可能であった。

2.研究の目的

本研究は、各種極微細加工用の高精度複合 型ダイヤモンドツールの開発と微細構造デ バイスへの応用を目的としている。具体的に は、以下の4項目を目標としている。

(1)各種形状のシリコンモールド作製技術 と、高緻密高速成膜可能なダイヤモンド CVD 技術を駆使して、高精細のアレイ状ダイヤモ ンド薄膜から形状精度よく切れ刃(ダイヤモ ンドチップ)を抽出し、それを工具シャンク に高強度で装着する手法を確立するととも に、ダイヤモンドチップとシャンクとを高精 度で位置決め可能なステージやセンサを具 備した工具作製装置を構築する。

(2)試作した装置や CVD ダイヤモンドの 直接・選択成長技術を用いて、各種の微細加 工機能を具備するダイヤモンドツールを開 発するとともに、高アスペクト比の微細 V 溝 加工を実現するツールを開発すること。

(3)これらを用いた加工実験を通じてツー

表1 FIB 加工条件

加速電圧	(kV)	40
ビーム電流	(nA)	0.83, 4.18
ドエルタイム	(µs)	10



図1 マイクロミリングツール



図 2 加工用 AFM カンチレバー

ルの性能評価を行い、精度を向上させる。

3.研究の方法

(1) FIB による加工用 AFM カンチレバー切 れ刃の加工

ダイヤモンドアレイ工具を加工用 AFM カン チレバーの切れ刃として用いた場合、先端角 70。6°の四角錐形状に規定されるため、狭 ピッチの微細溝加工は困難である。そこで、 切れ刃先端部を先鋭化する手段として、集束 イオンビーム加工装置(日立ハイテクノロジ ーズ社製:FB-2100、以下 FIB 装置と呼ぶ) を用いた。FIB 装置を用いて凹加工を行った 場合、加工底面よりも加工側面の方が加工面 精度はよい。また、テーパ角やダレによる加 工精度の低下は、ビーム電流を低くすること により解決できる。以上のことを踏まえ、FIB 加工方法および条件を決定した。

表1は、FIB加工条件である。4。18nAの ビーム電流で荒加工を行ったあと、0。83nA のビーム電流で仕上げ加工を行う。図3(a) は、ダイヤモンド切れ刃の先鋭化の概略図で ある。カンチレバー長手方向前面から、設定 した角度でFIB照射することにより任意の先 端角の切れ刃を作製した。図3(b)は、すくい 角導入の概略図である。目的とする先端角の 切れ刃を作製後、カンチレバー側面から設定 した角度でFIB照射することにより、任意の すくい角を導入した。図4は、FIB加工後の







(b) 側面

(a) 正面

図4 FIB 加工後の切れ刃の SEM 観察像



図5 加工装置の概略

加工用 AFM カンチレバー切れ刃の SEM 観察像

である。図のように、先端角 35°、切れ刃先 端丸み半径 20nm のダイヤモンド切れ刃を得 ることができた。

(2) 溝加工実験装置および実験条件

図5は、加工装置の概略である。加工装置 として使用する AFM(島津製作所社製: SPM-9500J2)では、カンチレバーが試料表面 を走査する際に、直線往復運動と送り運動を 交互に繰り返す。そのため、同線上を切れ刃 が往復路で2度通過することになる。そのた め、切れ刃先端部のすくい角は両側に形成さ れている。また、AFM へのカンチレバーの取 り付け角は装置の構造上、試料に対して13° 傾斜している。そのため、カンチレバーを 13°傾斜させた状態でFIB加工を行うことで、 切れ刃先端部と試料が平行に接触するよう にした。以後、すくい角は、この傾斜を考慮 した角度で表記する。

被削材は、微細金型での利用を想定して、 ステンレス鋼 (SUS420J2) に厚さ 150µm の Ni-P 合金めっきを施したものを用いた。表2 は、溝加工実験条件である。垂直荷重は、表 の範囲内で6段階に変化させ、加工中のフォ ースカーブを測定し、得られたたわみとカン チレバーのたわみ剛性の積で求めた。加工実 験前後のカンチレバー切れ刃先端および加 工溝は、電界放射型走査電子顕微鏡(日本電 子製:JSM-6700F)にて観察を行った。加工 溝形状の評価は、加工溝直上から FIB 装置に より矩形状に断面加工し、断面形状の観察と、 加工溝深さおよび幅の測定を行った。なお、 加工溝深さは、V 溝の両斜面から底部方向へ の延長線の交点と被削材表面との距離とし た。また幅は、V 溝両斜面からの表面方向へ の延長線と被削材表面との交点間の距離と した。

- 4.研究成果
- (1)先端角の影響

まず先端角の影響を検討するため、25°および35°の切れ刃先端角を有するカンチレバーを作製し、溝加工実験を行った。すくい角は0°とした。

図 6(a)および(b)は、各先端角における垂 直荷重に対する加工溝の深さ、幅、およびア スペクト比(深さ/幅)である。図中、アス ペクト比 2.26 および 1.59 のラインは、それ ぞれ先端角 25°および 35°の切れ刃断面形 状から算出した値を示している。どちらの先 端角も、垂直荷重の増加とともに加工溝の深 さ、幅ともに増加している。アスペクト比に ついては先端角25°の場合、垂直荷重の増加 とともに 2.26 に近づいていくが、垂直荷重 を大きくしていくと切れ刃が欠損したため、 これ以降の変化は確認できなかった。欠損は、 切れ刃強度が低いためと考える。一方、先端 角 35°の場合、垂直荷重に係らず、1.59 に は達していないが、ほぼ一定値をとることが わかる。



表 2 溝加工条件

図6 垂直荷重と溝深さ、幅、アスペクト比の関係



図7 切れ刃先端、先端丸み、溝断面の SEM 観察像

図7は、加工前のカンチレバーの切れ刃先 端、先端丸みと加工溝の SEM 観察像である。 いずれも図5において、最大荷重時(先端角



図 8 ダイヤモンド切れ刃列の SEM 像

25°は1030uN、先端角35°は1692uN)のも のである。先端角 25°で加工した場合、加工 溝の両側にバリ状の盛り上がりが観察され る。これは、被削材を横に押し広げる塑性変 形によると考える。一方、先端角 35°で加工 した場合は、盛り上がりも少なく良好な加工 が行われている。SEM 観察像から推定される 切れ刃の先端丸み半径は、先端角 25°では 100nm 程度、先端角 35°では 20nm 程度であ る。これは、FIB 装置で先端角を導入すると き、いずれも同条件で加工を行ったため、先 端角 35°よりも除去体積の大きな先端角 25°の方が加工時間を要し、切れ刃先端がだ れたためと考える。図6において、先端角25° のアスペクト比が一定にならず低垂直荷重 域において低い値を示したのは、先端丸みが 大きいため十分な切込みが得られなかった ためと考える。

## (2)多刃工具の作製と結果

上記では1本のカンチレバーに1つのダイ ヤモンド切れ刃を装着しているため、同形状 の加工を広範囲で行う場合、加工時間が長く なるという課題が残る。そこでAFM機構を用 いた高能率微細加工を想定し、1本のカンチ レバー先端に複数の多結晶ダイヤモンド切 れ刃を具備した加工用AFMカンチレバー(以 下、多刃カンチレバーと呼ぶ)での作製を行 い、加工実験を行った。

シリコンモールド金型を作製し、切れ刃ピッチ22µm、1辺20µmの四角錐形状のダイヤモンド切れ刃列を作製した。図8は、作製したダイヤモンド切れ刃列のSEM観察像で、4つの四角錐形状切れ刃が1列に並んでいる。

図9は、ダイヤモンド切れ刃列の装着方法 の概略である。以下にその手順を示す。

(a) 22µm 間隔で整列しているダイヤモンド アレイ工具から、4 つ分の切れ刃列を YAG レ ーザ加工装置(澁谷工業製:SDL-100N)によ り切断して抽出する。

(b) 抽出した切れ刃列を、顕微鏡下でマニュ ピレータによりカンチレバーにエポキシ系 接着剤で装着する。

(c) 加工用 AFM 多刃カンチレバーの完成。

図 10 は、作製した多刃カンチレバーの SEM 観察像である。

作製した多刃カンチレバーの評価を行う



図 9 ダイヤモンド切れ刃列の装着方法



図 10 多刃カンチレバーの SEM 像



図 11 引き切り加工痕の SEM 像

ため、引き切り加工実験を行った。図 11 は、 引き切り加工痕の SEM 観察像である。4 つ全 ての切れ刃が、2µm 間隔でそれぞれ 10 本の 引き切り加工を行っており、異なる場所の同 時加工が行われていることがわかる。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

【雑誌論文】(計 3 件) 高野登、清水大志、山田茂、<u>森田昇、</u>ダイ ヤモンドアレイ工具を用いたマイクロ加 工に関する研究 第3報:FIB により先 鋭化した加工用 AFM カンチレバーを用い た微細∨溝加工、砥粒加工学会誌、査読 有、掲載決定(2014) 高野登、園部修也、山田茂、<u>森田昇</u>、ダ イヤモンドアレイ工具を用いたマイクロ 加工に関する研究 第4報:加工用 AFM カンチレバーを用いた高能率微細加工、 砥粒加工学会誌、査読有、掲載決定 (2014) Noritaka Kawasegi、 Tomoyuki Niwata、 <u>Noboru Morita</u>、 Kazuhito Nishimura、 Hideki Sasaoka、 Improving machining performance of single-crystal diamond toolsirradiated by a focused ion beam、 Precis. Engin. 査読有、38 巻、 1 号 (2013) 174-182.

- 庭田智行、川堰宣隆、<u>森田昇</u>、西村一仁、 笹岡秀紀、集束イオンビーム(FIB)を用 いたダイヤモンド切削工具の作製とその 切削加工特性、2013年度精密工学会春期 大会学術講演論文集、(2013)329-330、 東京都目黒区、2013年3月13日。 園部修也、高野登、山田茂、<u>森田昇</u>、加 工用AFMカンチレバーを用いた高能率 微細加工に関する研究、2013年度精密工 学会春期大会学術講演論文集、(2013) 333-334、東京都目黒区、2013年3月13 日。
- 〔図書〕(計 0 件)
- [産業財産権] 出願状況(計 0 件)

取得状況(計件)

〔その他〕 なし

6.研究組織

(1)研究代表者
森田 昇(MORITA、 Noboru)
千葉大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号:30239660

(2)研究分担者
松坂 壮太(SOUTA、 Matsusaka)
千葉大学・大学院工学研究科・助教
研究者番号: 31334171

比田井 洋史(HIDAI、 Hirofumi)千葉大学・大学院工学研究科・准教授研究者番号: 60313334

(3)連携研究者 なし